

山村和也先生が国際光工学会 (The International Society for Optics and Photonics: SPIE) より Rudolf Kingslake Medal and Prize を受賞されることが決まりました。

SPIE は 166 カ国、264,000 人の会員から構成され、光学、フォトニクス、画像工学の分野における基礎研究と工学的応用の発展を国際会議、教育活動そして学術書の出版を通して推進することを目的とした非営利の世界最大規模の国際的な学会です。Rudolf Kingslake Medal and Prize は SPIE の公式学術誌である *Optical Engineering* 誌に 1 年間に掲載された論文の中から最も顕著であると認められた論文 1 報に授与される賞です。

今回の受賞対象となった論文は 2015 年の 5 月号に掲載された "*Mechanism analysis on finishing of reaction-sintered silicon carbide by combination of water vapor plasma oxidation and ceria slurry polishing*" (doi:10.1117/1.OE.54.5.055106) です。本論文は軽量の宇宙望遠鏡や高精度ガラスレンズの金型等に用いられる反応焼結 SiC 材料に対して、山村先生が提唱されたプラズマ照射による表面改質と砥粒研磨を複合したプラズマ援用研磨を適用した場合の加工メカニズムを検討したものであり、高精度な光学素子を作製する上で不可欠な超精密加工技術が評価されました。

授賞式は 2016 年 8 月 31 日に SPIE Optics + Photonics 2016 (San Diego, USA) で行われます。

Rudolf Kingslake Medal and Prize

<http://spie.org/about-spie/awards-programs/current-award-winners/rudolph-kingslake-medal-and-prize>

SPIE のプレスリリース

<http://spie.org/about-spie/press-room/press-releases/ultraprecision-silicon-carbide-polishing-researchers-win-rudolf-kingslake-award-10-aug-2016>